

NEDO評価部 「次世代プリントエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術
開発」(事後評価)分科会
担当 谷田 行

締切 : 2019年10月18日(金)
FAX : 044-520-5162

以下の分科会の一般傍聴を申し込みます。

分科会名 : 「次世代プリントエレクトロニクス材料・プロセス
基盤技術開発」(事後評価)分科会

※非公開セッションがある場合、該当部分は傍聴不可となりますので、ご注意ください。
なお、議事進行状況によって、時間が前後する可能性があります。

お名前			
所属機関			
所属部署		役職	
tel		fax	
e-mail			

本委員会の傍聴のお申し込みは **FAX** でお願いいたします。
FAX : 044-520-5162

※今回取得した個人情報につきましては、本分科会の一般傍聴申込みに関する事項に利用するのみであり、本目的以外で利用することはありません。ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。